

JIMTOF 2018

精密測定機器

活用セミナーのご案内

主催 日本精密測定機器工業会
合同技術委員会
三次元測定機部会

日本のものづくり産業においては精密測定機器の普及が進んでいるものの、産業層やアプリケーションによってはそれらが活用されていない領域があります。また、IATF16949の発行等により、その測定管理の重要性が増しています。そういった背景をもとに精密測定機器の有効性を示すことで更なる普及を図り、日本のものづくり産業の活性化に寄与するため、本セミナーを企画いたしました。

受講をご希望の方は、次頁申込書に必要事項をご記入の上、当工業会までお申込みください。

開催日時 2018年11月5日(月) 午前10時00分～午後4時30分

開催場所 東京ビッグサイト 会議棟1階 101会議室

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分

ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分

参加人数 定員120名(定員となり次第、締め切らせて戴きます)

参加費 無料

プログラム 詳細は裏面をご覧ください。

10:00～12:15 第一部 精密計測の基本技術

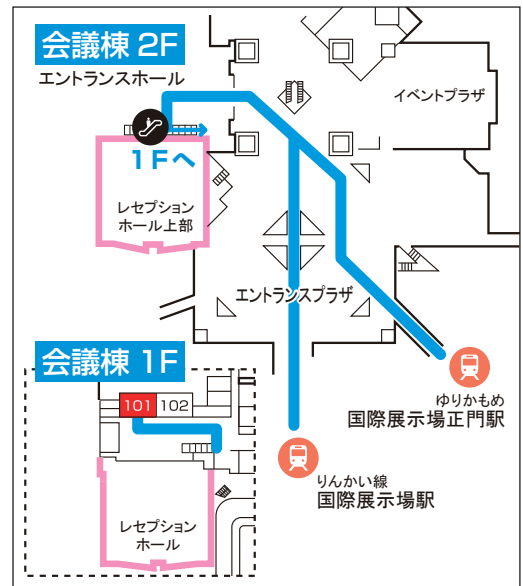
13:15～15:00 第二部 計測技術動向と活用

15:10～16:30 第三部 三次元座標測定機の活用ヒント

お問い合わせ 日本精密測定機器工業会

TEL: 03-3434-9557

E-mail: info@jpmia.gr.jp



JIMTOF2018 精密測定機器活用セミナー申込書

下記に必要事項をご記入いただき、お申し込みください。

お申し込みをいただいた方には、当工業会より『参加お申し込み受付票』をお送りいたします。

お申込み代表者

貴社名	
お名前(フリガナ)	(フリガナ)
〒ご住所	
所属部署	
お役職名	
TELおよびFAX	(TEL) (FAX)
メールアドレス	

※受講者全員のお名前をご記入ください。

受講者

	お名前	所属部署	お役職名	参加希望セッション
1				1・2・3
2				1・2・3
3				1・2・3
4				1・2・3
5				1・2・3

※下記のセッション名から、参加を希望されるセッション番号に○をつけてください。(複数選択可)

※受講者多数の際は調整させていただく場合がございます。予めご了承ください。

セッション名

1 精密計測の基本技術

2 計測技術動向と活用

3 三次元座標測定機の活用ヒント

お申込みは下記まで

FAX: 03-3434-1695 または e-mail: info@jpmia.gr.jp

JIMTOF 2018 精密測定機器活用セミナー

概要

- ・開催日時／2018年11月5日(月) 午前10時00分～午後4時30分
 - ・開催場所／東京ビッグサイト 会議棟1階 101会議室 (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)
 - ・参加人数／最大120名 ・参加費／無料 ・お申し込み期限／10月31日
- ※お申し込み期限以降のキャンセルはご遠慮ください。その場合、テキスト代として2,000円を申し受けます。代理の方のご出席をお願いします。

第一部 精密計測の基本技術

時間	セッション名	講演者
10:00 ～ 10:45 (45分)	測定不確かさ －ブロックゲージの比較校正を事例として－	国立研究開発法人産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門長さ標準研究グループ グループ長 尾藤 洋一 氏
10:45 ～ 11:30 (45分)	表面性状評価における基本技術 －線から面まで－	公立大学法人首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 生産システム工学コース 教授 深津 拓也 氏
11:30 ～ 12:15 (45分)	先進加工計測の技術動向 －ナノ製造基盤への展開－	大阪大学 大学院工学研究科 教授 高谷 裕浩 氏

第二部 計測技術動向と活用

時間	セッション名	講演者
13:15 ～ 14:00 (45分)	CMMの技術動向 －多数点群によるCMMの性能評価法の国際標準化にむけて－	国立研究開発法人産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門幾何標準研究グループ グループ長 阿部 誠 氏
14:00 ～ 14:30 (30分)	JEITA 三次元CAD情報標準化 専門委員会 活用・実証分科会活動紹介 －設計～製造/検査まで、Totalの効率化と品質の担保/向上－	富士ゼロックス株式会社 CS品質本部 品質保証部 マネージャ 重田 国啓 氏
14:30 ～ 15:00 (30分)	現場環境における三次元測定機の高度化 －直角誤差補正および回転式プロービングシステムの評価－	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 多摩テクノプラザ 電子・機械グループ 主任研究員 大西 徹 氏

第三部 三次元座標測定機の活用ヒント

時間	セッション名	講演者
15:10 ～ 15:35 (25分)	三次元測定機における座標系の考え方 －実際の運用を考慮した座標系の設定方法について－	石川県工業試験場 機械金属部 専門研究員 根田 崇史 氏
15:35 ～ 16:00 (25分)	プロービング圧の変化による測定精度への影響 －プロービング圧とスタイラスサイズの変更による測定結果の違い－	地方独立行政法人 山口県産業技術センター 企業支援部 加工技術グループ 専門研究員 永田 正道 氏
16:00 ～ 16:25 (25分)	画像測定機の照明光量と形状測定値の関係 －推奨光量で測定すれば大丈夫?－	国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 幾何標準研究グループ 主任研究員 銀島 麻理子 氏